ウルツ鉱型 MgSnN_2 のカチオン比による物性制御Property Tuning of Wurtzite MgSnN_2 by Cation Stoichiometry

1)中部大院工 2)物材機構 3)大阪府大工

○松浦健太¹⁾、川村史朗²⁾、井村将隆²⁾、村田秀信³⁾、山田直臣¹⁾

1) Chubu Univ. 2) NIMS 3) Osaka Pref. Univ.

○K. Matsuura,¹⁾ F. Kawamura,²⁾ M. Imura,²⁾ H. Murata,²⁾ N. Yamada,¹⁾

E-mail: n-yamada@isc.chubu.ac.jp

【背景】 従来の半導体上にエピタキシャル成長し、バンドギャップ(E_g)が、1.8-2.5 eV である半導体は限られている。我々はウルツ鉱型構造の MgSnN_2 (wz-MgSnN_2)を GaN(001)上にエピタキシャル成長させ、 $E_g \approx 2.7$ eV であることを明らかにした。[1]したがって、 wz-MgSnN_2 は従来の緑色発光半導体の代替材料として期待できる。本研究では $\text{wz-Mg}_{1+x}\text{Sn}_{1-x}\text{N}_2$ 薄膜を GaN(001)上にエピタキシャル成長させ、カチオン比 x の変化により、 E_g 及び電気伝導性の制御が可能であるかを調べた。

【実験】 窒素雰囲気下で、Mg と Sn を共スパッタすることで、400°Cに加熱した GaN(001)基板上に $\text{wz-Mg}_{1+x}\text{Sn}_{1-x}\text{N}_2$ 薄膜を作製した。X 線回折測定 (XRD)、Hall 効果測定、分光透過・反射測定、ICP 発光分析により評価した。

【結果】 図 1 は $\text{wz-Mg}_{1+x}\text{Sn}_{1-x}\text{N}_2$ 薄膜の代表的な XRD パターンである。 $x = -0.2 \sim 0.2$ の広い範囲で、単相の $\text{wz-Mg}_{1+x}\text{Sn}_{1-x}\text{N}_2$ のエピタキシャル薄膜が得られることがわかった。

図 2 に示した Tauc プロットを使って、 E_g の x 依存性を調べた。この結果から、 $\text{wz-Mg}_{1+x}\text{Sn}_{1-x}\text{N}_2$ の組成が Sn 過剰 ($x < 0$) から Mg 過剰 ($x > 0$) になるにつれて、 E_g は 2.8 eV から 2.2 eV に小さくなっていくことがわかった。

今回作製した薄膜は、組成によらず n 型伝導を示した。抵抗率、電子濃度、移動度はそれぞれ x が増えるにしたがって、 10^{-1} から $10^{-2} \Omega \cdot \text{cm}$ 、 10^{20} から 10^{19} cm^{-3} 、8 から $3 \text{ cm}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ と変化してい

くことがわかった。

以上から、 $\text{wz-Mg}_{1+x}\text{Sn}_{1-x}\text{N}_2$ エピ膜の x を変化させることで物性の制御が可能であることがわかった。 x による物性変化の起源については当日議論する。

図 1 wz-MgSnN_2 薄膜の XRD パターン。*で記されているピークは GaN,Sapphire のピーク

図 2 $\text{wz-Mg}_{1+x}\text{Sn}_{1-x}\text{N}_2$ 膜の Tauc プロット。挿図は E_g vs x 図を示す

【参考文献】

[1] 松浦ら、第 80 回 応用物理学会秋季学術講演会 予稿集、18a-E206-6(2020)